

【裁判字號】100,行專訴,86

【裁判日期】1001222

【裁判案由】新型專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

100年度行專訴字第86號
民國100年12月1日辯論終結

原 告 全研科技有限公司

代 表 人 邱毓英

訴訟代理人 陳忠儀律師

輔 佐 人 曾正忠

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）住同上

訴訟代理人 江國塹

參 加 人 山騰科技股份有限公司

代 表 人 吳明山

訴訟代理人 陳啓舜律師

複代理人 錢師風律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國100年6月16日經訴字第10006100530號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國96年1月18日以「四驅動對位對準平台」向被告申請新型專利，旋於同年7月19日提出系爭專利申請專利範圍修正本，經被告編為第96200986號進行形式審查，准予專利，並於依法繳納規費後，發給新型第M319503號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違專利法第108條準用第26條第2項、第3項及第94條第4項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，認系爭專利有違專利法第94條第4項規定，以100年6月16日(99)智專三(一)05017字第09920952110號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部100年6月16日經訴字第10006100530號決定駁回遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並主張：

(一)證據1 之型錄無法證明其公開在系爭專利申請日期之前，不具證據能力：

- 1.證據1 「CMX」產品型錄係私文書，且可於事後製作，雖參加人指稱證據1 係由日商THK 股份有限公司（下稱日商THK 公司）於日本西元2005年11月5 日印製，然其並未取得日商THK 公司之證明、亦無任何有公信力單位之認證，如何確信其係日商THK 公司所印製者。又縱認證據1 之型錄係日商THK 公司所印製者，然其上「00000000」是否即為印製之日期，亦屬未能證明，退萬步言之，證據1 充其量僅能證明該型錄之印製日期，但並無法證明該型錄之公開發行日期。是以，顯見證據1 型錄應不具證據能力。
- 2.證據1 型錄所示「CMX」型對位平台構造僅能顯示「CMX」型對位平台之外觀，並無法有效地瞭解「CMX」型之詳細結構，故其與系爭專利尚缺乏完全比對之基礎。
- 3.由證據1 型錄第3 頁顯示其僅具有三組平移單元，其即屬系爭專利於先前技術中所謂「一種以三組平移旋轉單元結合三組驅動系統與一自由單元所組成的載具平台」，其會存在有旋轉運動之中心因三組驅動系統所造成的不固定現象，即為系爭專利所欲解決之問題，而系爭專利確實能達到預期之目的與功效。是以，系爭專利相較於證據1 具有進步性。
- 4.雖參加人認為證據1 型錄第12頁已揭露有「超高剛性高精度四軸驅動規格」，但其僅係單純地為文字敘述，並無任何結構的揭示，其四軸係如何佈設？相對關係為何？均付之闕如。故證據1 型錄顯然無法證明其有揭露系爭專利構造，且並未有任何相同或類似系爭專利有關第一、二平移旋轉單元之第一平移元件與第二平移元件的構成，又證據1 係另外使用所謂的十字LM導件來支撐與滑動，其整體結構遠較系爭專利複雜，不僅需要準備眾多的零件，且整體成本更遠高於系爭專利，且需要另外進行導螺桿與LM導件的平行度校準，不僅費時且困難，進而影響到其位移的精度，相較之下，系爭專利並無此一問題，其精度遠高於證據1 。
- 5.從而，系爭專利相較於證據1 型錄所示，確實具有進步性，並非其所屬技術領域中具有通常知識者，所能輕易完成者，且其能增進功效，為對物品之創新改良，已符合新型之定義。

(二)系爭專利相較於證據2 先前技術具有進步性：

證據2 日本特開0000000000號專利前案雖然具有+X軸、-X軸、+Y軸及-Y軸等四個平移機構，但其平移機構的步進馬達12

係透過一導螺桿14驅動一螺套10，且螺套10另設有一連結體9，連結體9並與一具XY軸滑動功能之十字導件，再於十字導件上利用轉動支柱3與移動平台4產生轉動。由於證據2係另外使用所謂十字導件14來支撐與滑動，其整體結構遠較系爭專利為複雜，不僅需準備眾多零件，整體成本更遠高於系爭專利，且需要另外進行導螺桿與十字導件之平行度與垂直度之校準，不僅費時困難，進而影響其位移之精度。反觀系爭專利並無前述結構複雜及校準等問題，其精度遠高於證據2。證據2並未有任何相同或類似系爭專利中有關第一、二平移旋轉單元3、3'之第一平移元件31與第二平移元件32之構成，而系爭專利能以極簡單之結構達到精度之要求，故系爭專利相較於證據2具有進步性。

(三)系爭專利相較於證據3先前技術，確實具有進步性：

- 1.證據3 日本特開0000000000號專利前案係一種旋轉軸軸承，亦係一種十字型滾輪軸承，係由一內輪2及一外輪3所構成，內輪2外周形成有一剖面呈V字形之槽2b，而外輪3則形成上、下兩部件6，兩部件並組成一對應前述槽2b之6b，內、外輪2、3之兩槽合成一轉走面7，供容置滾輪4。
- 2.反觀，系爭專利之旋轉單元5係由一底盤51、一轉動元件52及一固定元件54所組成，其中底盤51內部周圍形成有一環槽512，該環槽512內界定有一容置空間511，且底盤51再設有定位部513，而轉動元件52則設置於該底盤51之容置空間511中，轉動元件52於相對環槽512的一端環設有一凹槽部521，固定元件54的底端係固定於底盤51頂端，且其周圍亦形成有限位槽541，該限位槽541與導接部543、環槽512共同形成一滾動槽空間，且該滾動槽空間內佈設有複數滾動體53。
- 3.透過上述結構解析可知，兩者最大的結構差異在於系爭專利之底盤51具有一承載轉動元件52的容置空間511上，使轉動元件52可獲得有效的支撐，而能保持其平穩度，同時固定元件54並利用導接部543與底盤51之定位部513相對準確對位。至於證據3的外輪3下部6則係呈中空狀，所以內輪2唯一的支撐來自於滾輪4，因此在實際使用時，內輪2會因支撐不足，而與外輪3產生上、下錯位，故需要另外進行校正，同時外輪3的上、下部件6間單純利用螺絲8來鎖設，無法準確的對位，是以此加工精度之要求必須要較系爭專利為高，無形間即提高其加工成本與組裝的難度。
- 4.相較之下，證據3並無法揭露系爭專利之旋轉單元5之特徵結構。換言之，系爭專利之申請專利範圍第8項相較於證據

3 確實具有新穎性與進步性。因此，系爭專利之申請專利範圍第1、8 項中所述的旋轉單元絕非熟悉該項技術領域者依據證據3 所能易於思及達成者。

(四)證據1及2之組合並不能證明系爭專利不具進步性：

組合證據1 與證據2 之結構亦無法揭露系爭專利之第一、二平移旋轉單元3、3'中可產生相對位移與彈性位移的第一平移元件31與第二平移元件32，且驅動單元41並利用螺套33與螺桿42連接，同時旋轉單元5 更可直接產生旋轉運動，使系爭專利能有效達到精度要求之結構，無需利用證據1、2 之十字導件，當然亦無因平行度與垂直度校準所產生之費時、操作不易的問題。是以，系爭專利相較於證據1 組合證據2，確實具有進步性，具有該項技術領域之通常知識者尚無法依據證據1 組合證據2 先前技術，而思及系爭專利之內容。

(五)證據1、2 及3 之組合並不能證明系爭專利不具進步性：

證據1 或證據2 組合證據3 之結構仍然無法完全揭露系爭專利之結構特色，同時系爭專利之旋轉單元的動作更為準確、平穩，使系爭專利能較證據1、2 與證據3 的組合更具功效增進。是以，系爭專利相較於證據1 或證據2 組合證據3 更具有進步性，顯非熟悉該項技術領域者依據證據1 或證據2 組合證據3 先前技術所能輕易思及達成者。又系爭專利申請專利範圍第1 項與第8 項均具有進步性，已如上述，而系爭專利申請專利範圍第2 至7 項、第9 至12項係分別依附於申請專利範圍第1 項、第8 項之附屬項，其是否具有進步性需判斷涵蓋申請專利範圍第1 項、第8 項之全部內容。因此，於申請專利範圍第1 項、第8 項具有進步性時，依附於其下之附屬項應認同時具有進步性，而無違反專利法第94條第4 項規定之情事。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

(一)證據1 日商THK 公司於西元2005年11月5 日印製之整本型錄

正本底頁明確印有「00000000 Printed in Japan」，符合一般商業習慣，堪認證據1 於系爭專利申請日96年1 月18日之前已公開，且由證據2 日商THK 公司所有之西元2004 年4 月2 日公開之日本特開第2004-98276號專利案之技術內容，亦可佐證證據1 之相關技術早已公開之事實，故證據1 堪認具有證據能力。

(二)證據1 為整本型錄，其封面、第1、3、12頁及其他各頁等

不僅有圖面揭示外觀結構，亦有文字說明相關技術內容，且第1 頁係以剖面圖詳細揭示其內部構造，而第12頁除圖面構造亦以文字揭示「超高剛性高精密度4 軸驅動規格」等語，

依其整本型錄各頁揭示之圖面及文字說明，就其所屬技術領域中具有通常知識者自能輕易瞭解其技術內容。

(三)系爭專利申請專利範圍第1項與證據1相較，可知系爭專利申請專利範圍第1項為一種四驅動對位對準平台（即相當於證據1第1頁之對準平台），包括：數組第一平移旋轉單元3（相當於證據1之第一模組），分別包括有一安裝於固定平台上之驅動單元41、一可受該驅動單元41往X軸方向驅動位移之第一平移元件31、一可隨該第一平移元件31置移或產生相對位移之第二平移元件32（相當於證據1固定基座上的馬達、十字滾珠螺桿、十字LM導件），以及一可隨該第二平移元件32位移及提供旋轉作用之旋轉單元5（相當於證據1之十字滾動圓環）；數組第二平移旋轉單元3'（相當於證據1之第二模組），分別包括有一安裝於固定平台上之驅動單元41、一可受該驅動單元往Y軸方向驅動位移之第一平移元件31、一可隨該第一平移元件位移或產生相對位移之第二平移元件32（相當於證據1之馬達、十字滾珠螺桿、十字LM導件），以及一可隨該第二平移元件位移32及提供旋轉作用之旋轉單元5（相當於證據1之十字滾動圓環）；一量測平台2，以預定方式固定於該第一平移旋轉單元與第二平移旋轉單元之旋轉單元5上（相當於證據1之頂盤固定於兩組第一模組、第二模組上之十字滾動圓環上的組合模式），當預定之驅動單元41作動時，便可透過該等第一平移旋轉單元3、第二平移旋轉單元3'或第一平移旋轉單元與第二平移旋轉單元個別或共同驅動該量測平台2往X軸或Y軸位移或往預定方向旋轉（相當於證據1第3頁之頂盤可以預定之驅動馬達，透過第一模組、第二模組及十字滾動圓環，驅動頂盤往X方向或Y方向位移或往預定方向回旋之功效，參證據1型錄第3頁之動作原理，其已揭示X方向移動、Y方向移動及中心回轉、旋回移動之動作原理），是系爭專利申請專利範圍第1項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據1之先前技術顯能輕易完成者，證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

(四)證據2係一種移動平台裝置，即四驅動軸的結構，雖然證據2在細部構造及配置位置上稍有差異，惟證據2之X軸、Y軸移動機構即相當於系爭專利之第一、二平移旋轉單元3、3'。將二者比對可知，系爭專利申請專利範圍第1項為一種四驅動對位對準平台（即相當於證據2之移動平台裝置，參證據2圖3），包括：數組第一平移旋轉單元3（相當於證據2在固定基板1上Y方向的Y軸用移動機構Y3，參證據2

圖3、5），分別包括有一安裝於固定平台上之驅動單元41、一可受該驅動單元41往X軸方向驅動位移之第一平移元件31、一可隨該第一平移元件31置移或產生相對位移之第二平移元件32（相當於證據2 安裝於固定基板1 上的步進馬達12、導軌、螺桿14、軸套Y2等移動機構Y3，可任意前後方向移動），以及一可隨該第二平移元件32位移及提供旋轉作用之旋轉單元5（相當於證據2 移動平台4 的轉動支柱3）；數組第二平移旋轉單元3'（相當於證據2 在固定基板1 上的X軸用移動機構X3'，見證據2 圖3、5），分別包括有一安裝於固定平台上之驅動單元41、一可受該驅動單元往Y軸方向驅動位移之第一平移元件31、一可隨該第一平移元件位移或產生相對位移之第二平移元件32（相當於證據2 安裝於固定基板1 上的步進馬達12、導軌、螺桿14、軸套X2等移動機構X3'，可任意左右方向移動），以及一可隨該第二平移元件位移32及提供旋轉作用之旋轉單元5（相當於證據2 移動平台4 的轉動支柱3）；一量測平台2，以預定方式固定於該等第一平移旋轉單元與第二平移旋轉單元之旋轉單元5上（相當於證據2 之移動平台4 安裝於移動機構Y3與移動機構X3的轉動支柱3上），當預定之驅動單元41作動時，便可透過該等第一平移旋轉單元3、第二平移旋轉單元3'或第一平移旋轉單元與第二平移旋轉單元個別或共同驅動該量測平台2 往X軸或Y軸位移或往預定方向旋轉（亦如證據2 之移動平台4，可藉由該X軸用移動機構、Y軸用移動機構而使移動平台4 相對固定基板1 任意左右方向、前後方向移動、水平轉動之技術功效，見證據2 請求項1、圖3）。可見系爭專利四驅動對位對準平台，包括數組第一平移旋轉單元3、數組第二平移旋轉單元3'及一量測平台2，達成驅動該量測平台2 往X軸或Y軸位移或往預定方向旋轉的技術及功效，亦為證據2 之移動平台4，可藉由該X軸用移動機構、Y軸用移動機構而使移動平台4 相對固定基板1 任意左右方向、前後方向移動及水平轉動之技術功效所揭示，即便系爭專利在細部構造及配置位置上稍有差異，然證據2 與系爭專利同樣具有四組驅動移動機構及轉動機構，實質技術手段及功效仍屬相同，系爭專利仍僅係等效技術之簡單運用，仍為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易轉用完成者，並不具進步性。

(五)舉發理由原係以證據1 至3 之組合主張系爭專利申請專範圍第1 至12項不具進步性，該證據3 並非以單一證據比對，單一證據並非原舉發主張理由，故本件自仍以證據1 至3 之組

合證據論究。查證據3 旋轉軸軸承，如第1 圖至第3 圖揭示滾輪軸承1 係包含內輪2 、外輪3 及複數個設在該內輪2與外輪3 （溝槽2b）之間可作為轉動體任意轉動之滾輪4 及使該些滾輪4 以一定間隔保持固定之間隔扣件5 （見證據3 【0028】、【0029】段），可藉由容置在由內輪2 及外輪3所形成之轉走面7 ，以及滾輪4 之轉動，而使可動平台54相對固定台51形成可任意旋轉（見證據3 【0046】段、圖2 、3 ）。可見證據3 旋轉軸軸承有揭示：「可藉由容置在由內輪2 及外輪3 所形成之轉走面7 ，以及滾輪4 之轉動，而使可動平台54相對固定台51形成可任意旋轉的旋轉機構」之旋轉單元技術內容。又如前所述，證據1 已揭示十字滾動圓環、證據2 已揭示轉動支柱3 …等技術特徵，而證據3 旋轉軸軸承亦揭示：可藉由容置在由內輪2 及外輪3 所形成之轉走面7 ，以及滾輪4 之轉動，而使可動平台54相對固定台51 形成可任意旋轉的旋轉機構，而證據1 或2 可證系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述，故組合證據1 及2 、組合證據1 及3 或組合證據2 及3 或組合證據1 、2 及3 自可證明系爭專利不具進步性。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

（一）證據1具證據能力：

1. 證據1 型錄之印製內容及底頁印製有「00000000於日本印刷」，其印製方式符合一般商業習慣，且該證據1 型錄係經公開始由參加人取得，參酌證據1 之印製者為「THK CO.,LTD」（日商THK 公司）亦與證據2 之申請人相同，且該證據1第1 內頁亦載有「特許出願中（專利申請中）」，又比對該證據1 與證據2 技術內容亦相符合，足證該證據1 為系爭專利申請前已公開之刊物，故證據1 具有證據能力。
2. 證據1 揭示一種對準平台，採用了獨自之模組，數模組設在基座、頂盤間之四個角落，將組合了十字LM導件CSR 形及特殊十字滾動圓環之模組，採用平面配置之獨特的構造，以實現超薄型構造。該「對準平台」適用於液晶面板製造裝置、檢查裝置；半導體製造裝置、檢查裝置；篩板印刷機；印刷基板製造裝置、檢查裝置等。證據1 第3 頁教示「對準平台」係藉由X1、X2、Y 三軸之作動的組合，而可進行各種之平台的運動；又證據1 第10頁教示「對準平台」模組數可為8 組至10組；證據1 第12頁所揭示之「超高剛性高精密度4軸驅動規格」對準平台亦與系爭專利所揭示之「四驅動對位對準平台」完全相同，而證據1 第13頁更教示：「使LM導件、滾珠螺桿、十字滾動圓環之型號增大，且藉由將每一模組一

組之定格負荷提高，而可承受高負載負荷。針對想要之搭載質量，進行最佳之模組設計、製作」。上述教示內容均清楚記載於證據1 內，且配合證據1 之圖式，實已得有效地瞭解「CMX」型之詳細結構，故證據1 所公開之技術內容，為該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易理解。因此，證據1 具有證據能力，且證據1 已清楚記載與系爭專利相對應技術內容。是以，被告援引證據1 認定系爭專利不具進步性並無違誤，原告主張無理由。

(二)證據1 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：

- 1.系爭專利「數組第一平移旋轉單元3、數組第二平移旋轉單元3'」，即對應於證據1 之「第一模組、第二模組」；系爭專利之「數組第一平移旋轉單元3、數組第二平移旋轉單元3'各分別包括有一安裝於固定平台1 上之驅動單元41」，即對應於證據1 之「第一模組、第二模組各分別包括有一安裝於基座上之伺服馬達」；系爭專利之「固定平台1」即對應於證據1 之「基座」；系爭專利之「驅動單元41」即對應於證據1 之「伺服馬達」；系爭專利之「可受該驅動單元往X(Y)軸方向驅動位移之第一平移元件、一可隨該第一平移元件位移或產生相對位移之第二平移元件」即對應於證據1 之「十字LM導件」；系爭專利之「可隨該第二平移元件位移及提供旋轉作用之旋轉單元5」即對應於證據1 之「十字滾動圓環」。
- 2.系爭專利「四驅動對位對準平台，包括數組第一平移旋轉單元3、數組第二平移旋轉單元3'及一量測平台2，達成驅動該量測平台2 往X 軸或Y 軸位移或往預定方向旋轉」功效，亦與證據1 「對準平台之頂盤可以預定之伺服馬達，透過分置四個角落的兩組第一模組、第二模組及十字滾動圓環，以驅動頂盤往X 方向或Y 方向位移或往預定方向回旋」功效相同，系爭專利亦未能增進功效。
- 3.因此，證據1 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

(三)證據2 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：

- 1.系爭專利「數組第一平移旋轉單元3、數組第二平移旋轉單元3'」即對應證據2 之「X 軸用移動機構X3、X'3、Y 軸用移動機構Y3、Y'3」；系爭專利「該數組第一平移旋轉單元3、數組第二平移旋轉單元3'各分別包括有一安裝於固定平台1 上之驅動單元41」即對應證據2 之「X 軸用移動機構X3、X'3、Y 軸用移動機構Y3、Y'3 各分別包括有一安裝於基板1 上之步進馬達12」；系爭專利「固定平台1」即對應證

據2「基板1」，系爭專利之「驅動單元41」即對應證據2之「步進馬達12」；系爭專利「可受該驅動單元往X(Y)軸方向驅動位移之第一平移元件31、一可隨該第一平移元件31置移或產生相對位移之第二平移元件32」即對應證據2之「可受該步進馬達12往X(Y)軸方向驅動位移之X軸用移動機構X3、X'3(Y軸用移動機構Y3、Y'3)、一可隨該X軸用移動機構X3、X'3(Y軸用移動機構Y3、Y'3)位移或產生相對位移之上部導軌X_y、X'_y(上部導軌Y_x、Y'_x)」；系爭專利「可隨該第二平移元件32位移及提供旋轉作用之旋轉單元5」即對應證據2之「轉動支柱3」。

2. 系爭專利「四驅動對位對準平台，包括數組第一平移旋轉單元3、數組第二平移旋轉單元3'及一量測平台2，達成驅動該量測平台2往X軸或Y軸位移或往預定方向旋轉」功效，亦與證據2「移動平台4，可藉由該X軸用移動機構、Y軸用移動機構而使移動平台4相對固定基板1任意左右方向、前後方向移動及水平轉動」之功效相同，系爭專利亦未能增進功效。
3. 因此，證據2可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

(四)證據1至證據3之任意組合可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

1. 證據3「旋轉軸軸承」揭示：「滾輪軸承I係包含內輪2、外輪3及複數個設在該內輪2與外輪3(溝槽2b)之間可作為轉動體任意轉動之滾輪4及使該些滾輪4以一定間隔保持固定之間隔扣件5(見證據3[0028]、[0029]段)，可藉由容置在由內輪2及外輪3所形成之轉走面7，以及滾輪4之轉動，而使可動平台54相對固定台51形成可任意旋轉(見證據3[0046]段、圖2、3)」。
2. 證據1已揭示「十字滾動圓環」、證據2揭示「轉動支柱3」，且證據3亦揭示：「可藉由容置在由內輪2及外輪3所形成之轉走面7，以及滾輪4之轉動，而使可動平台54相對固定台51形成可任意旋轉的旋轉機構」，則在如前所述之證據1、證據2可以證明系爭專利申請專利範圍第1項(獨立項)不具進步性之前提下，證據1或證據2再組合證據3，或證據1、2、3之任意組合，足可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

(五)系爭專利申請專利範圍第2至7項不具進步性：

1. 系爭專利申請專利範圍第2至7項附屬項係依附於申請專利範圍第1項(獨立項)，第1項不具進步性已如前述。

2. 系爭專利申請專利範圍第2 項界定之該旋轉單元5（即相當於證據3 之滾輪軸承1）更進一步包括有：底盤51，其內部周圍形成有一容置空間，該容置空間周壁形成有預定形狀之環槽512（即相當於證據3 外輪3 之下環部件6，及其內部圓錐面6c形成的溝6b）；轉動元件52，可設置於底盤之容置空間中，且相對環槽的一端環設有一凹槽部，同時，該轉動元件可用以固定支撐量測平台相對部位（相當於證據3 之內輪2，及其內部圓錐面2c形成的溝6b）；固定元件54，係固定於底盤頂端，且其周圍亦形成有限位槽（相當於證據3 之外輪3 之上環部件6，及其內部圓錐面6c形成的溝6b），該限位槽541 亦與該凹槽部521、環槽512 共同形成一滾動槽空間（相當於證據3 之溝槽2b、6b形成之空間）；複數滾動體53可分別容納分佈於該底盤之環槽、轉動元件之凹槽部與固定元件之限位槽所共同界定的滾動槽空間中（相當於證據3 之複數滾輪4 容納在該內輪2 與外輪3 之溝槽2b、6b形成的空間）。系爭專利申請專利範圍第2 項乃為其所屬技術領域中具通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成。因此，組合證據1 與證據3，或組合證據2 與證據3，或證據1、2、3 之任意組合，係可以證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。
3. 系爭專利申請專利範圍第3 項界定「其中該驅動單元為一馬達」，其亦與證據1 第1 頁圖式之馬達、證據2 揭示「該驅動單元為一步進馬達12」相同。因此，組合證據1 與證據3，或組合證據2 與證據3，或證據1、2、3 之任意組合，可以證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性。
4. 系爭專利申請專利範圍第4 項界定「其中該驅動單元可驅動一螺桿42，再藉由螺桿上之螺帽連動相對的第一平移元件產生位移」，該驅動螺桿與證據1 第1 頁之螺桿、證據2 第1 圖之螺桿14相同。因此，組合證據1 與證據3，或組合證據2 與證據3，或證據1、2、3 之任意組合，可以證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性。
5. 系爭專利申請專利範圍第5 項界定「其中該驅動單元為線性馬達時，該線性馬達亦直接驅動第一平移元件產生位移」。證據1 第1 頁圖式揭示「驅動單元為一馬達」，以及證據2 揭示「該驅動單元為一步進馬達12」，而將「馬達或步進馬達12」改變為「線性馬達」，僅為其所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，不具進步性。因此，組合證據1 與證據3，或組合證據2 與證據3，或證據1、2、3 之任意組合，可以證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性。

6.系爭專利申請專利範圍第6項界定「其中該第一平移旋轉單元與第二平移旋轉單元之安裝方向相差九十度」，而證據1第1頁圖式揭示「十字LM導件」，該「十字LM導件」顧名思義可知其「安裝方向相差九十度」，以及證據2第【0006】段揭示「將與下部X軸導軌X1、X'1垂直之一定長度之上部Y軸導軌Xy、X'y可任意前後滑動的嵌入該X軸套X2、X'2之上部」，以及「將與下部Y軸導軌Y1、Y'1垂直之一定長度之上部X軸導軌Yx、Y'x可任意左右滑動的嵌入該Y軸套Y2、Y'2之上部」。因此，組合證據1與證據3，或組合證據2與證據3，或證據1、2、3之任意組合，可以證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性。

7.系爭專利申請專利範圍第7項界定「該四驅動對位對準平台，包括有二組呈對角設置之第一平移旋轉單元，以及二組呈對角設置之第二平移旋轉單元」，而證據1第12頁圖式揭示「超高剛性高精密度4軸驅動規格」即為二組呈對角設置，以及證據2揭示「該X軸用移動機構X3、X'3、Y軸用移動機構Y3、Y'3」亦為二組呈對角設置。因此，組合證據1與證據3，或組合證據2與證據3，或證據1、2、3之任意組合，可以證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性。

(六)系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性：

1.系爭專利申請專利範圍第8項界定「一種四驅動對位對準平台用旋轉單元，包括：一底盤，其內部周圍形成有一環槽，該環槽內界定有一容置空間，而該底盤亦再設有定位部；一轉動元件，可設置於底盤之容置空間中，且相對環槽的一端環設有一凹槽部；一固定元件，其底端係固定於底盤頂端，且其周圍亦形成有限位槽，該限位槽與凹槽部、環槽共同形成一滾動槽空間；複數滾動體，可分別容納分佈於滾動槽空間」。

2.系爭專利請求項之「旋轉單元5」（即相當於證據3之滾輪軸承1）包括：一底盤51，其內部周圍形成有一環槽512，該環槽內界定有一容置空間511（相當於證據3外輪3之下環部件6，及其內部圓錐面6c、可供容納內輪2的容置空間），而該底盤51亦再設有定位部513（相當於證據3上下環部件6之螺桿8）；一轉動元件52，可設置於底盤之容置空間511中，且相對環槽512的一端環設有一凹槽部521（相當於證據3之內輪2設置於外輪3之容置空間中，及其內部圓錐面2c）；一固定元件54，其底端係固定於底盤頂端，且其周圍亦形成有限位槽541（相當於證據3之外輪3相互固定之上下環部件6，及其內部圓錐面6c），該限位槽541與

凹槽部521、環槽512共同形成一滾動槽空間（相當於證據3之溝槽2b、6b形成之空間）；複數滾動體53，可分別容納分佈於滾動槽空間（相當於證據3之複數滾輪4分佈於該溝槽2b、6b形成的空間）。

3. 系爭專利申請專利範圍第8項之技術特徵已為證據3所揭露，該請求項僅為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，證據3可以證明系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性。
4. 證據1亦揭示「十字滾動圓環」及證據2揭示「轉動支柱3」，則組合證據1及證據3，或組合證據2及證據3，或證據1、2及3之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性。

(七)系爭專利申請專利範圍第9至12項不具進步性：

1. 系爭專利申請專利範圍第9至12項附屬項係依附於申請專利範圍第8項（獨立項），第8項（獨立項）不具進步性已如前述。
2. 系爭專利申請專利範圍第9項界定：「其中該固定元件其上係可開設通孔」，而證據1第1頁揭示「十字滾動圓環上的螺孔」、證據3圖1、2揭示「環部件6上(螺桿8)之螺孔」。因此，組合證據1及證據3，或組合證據2及證據3，或證據1、2及3之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第9項不具進步性。
3. 系爭專利申請專利範圍第10項界定：「其中該固定元件54其底部設置有複數導接部543」，而證據1第1頁圖式教示與系爭專利相對應之「該底盤及轉動元件上係開設通孔供螺栓通過與頂盤螺固或結合」，證據2第【0032】段教示「在該軸套18之凸緣部設置嵌入該固定孔5之突設圓筒鏢部，該各個突設圓筒鏢部被嵌入各固定孔5，並由扣止螺絲21將軸套18之凸緣部固定在移動平台4」，系爭專利該請求項技術特徵僅為其所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成。因此，組合證據1及證據3，或組合證據2及證據3，或證據1、2及3之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性。
4. 系爭專利申請專利範圍第11項界定：「其中該導接部能以緊配合方式與底盤之定位部固定」，而證據1第1頁圖式教示與系爭專利相對應之「該底盤及轉動元件上係開設通孔供螺栓通過與頂盤螺固或結合」，證據2第【0032】段教示「在該軸套18之凸緣部設置嵌入該固定孔5之突設圓筒鏢部，該各個突設圓筒鏢部被嵌入各固定孔5，並由扣止螺絲21將軸

套18之凸緣部固定在移動平台4」。故系爭專利該請求項技術特徵僅為其所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成。又證據3 教示：「作為結合一對環部件6、6之結合裝置，其係包含螺絲8及螺帽9」，系爭專利該請求項技術特徵，亦僅為其所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成。因此，組合證據1及證據3，或組合證據2及證據3，或證據1、2及3之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性。

5. 系爭專利申請專利範圍第12項界定：「其中該固定元件之導接部定位設置於底盤之定位部後，再以粘著劑將固定元件與底盤固定」，而證據1第1頁圖式教示與系爭專利相對應之「該底盤及轉動元件上係開設通孔供螺栓通過與頂盤螺固或結合」，證據2第【0032】段教示「在該軸套18之凸緣部設置嵌入該固定孔5之突設圓筒鏢部，該各個突設圓筒鏢部被嵌入各固定孔5，並由扣止螺絲21將軸套18之凸緣部固定在移動平台4」。故系爭專利該請求項技術特徵為其所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成。又證據3 教示：「作為結合一對環部件6、6之結合裝置，其係包含螺絲8及螺帽9」。是以，系爭專利該請求項技術特徵亦僅為其所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成。因此，組合證據1及證據3，或組合證據2及證據3，或證據1、2及3之組合亦可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。

五、本件之爭點（見本院卷第85頁）：

- (一)證據1、證據2或證據1至證據3之任意組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性？
- (二)證據1至證據3之任意組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第2至7項不具進步性？
- (三)證據1至證據3之任意組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第8至12項不具進步性？

六、得心證之理由：

- (一)查系爭專利係於96年1月18日申請，被告於96年8月10日形式審查准予專利，並於同年9月21日公告，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法為斷。
- (二)按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第93條暨第94條第1項前段所規定。惟如新型「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，仍不得依法申請取得新型專利，同法第94

條第4 項復有明文。

(三)系爭專利技術分析

1.系爭專利係一種四驅動對位對準平台，主要包含有安裝於固定平台之兩組第一平移旋轉單元、兩組第二平移旋轉單元，以及一固定於該等平移旋轉單元上之量測平台，其中，利用該等平移旋轉單元中之驅動單元、兩可相對彈性位移之平移元件與旋轉單元，可使驅動單元適當作動時，得以透過該等第一平移旋轉單元個別驅動、第二平移旋轉單元個別驅動或第一平移旋轉單元與第二平移旋轉單元共同驅動該量測平台往X 軸或Y 軸位移或往預定方向旋轉，其主要圖式如圖一所示。

2.系爭專利請求項共計12項，其中申請專利範圍第1 、8 項為獨立項，申請專利範圍第2 至7 項為直接或間接依附於申請專利範圍第1 項之附屬項，申請專利範圍第9 至12項為直接或間接依附於申請專利範圍第8 項之附屬項。其內容分別如下：

第1 項：一種四驅動對位對準平台，包括：數組第一平移旋轉單元3，分別包括有一安裝於固定平台上之驅動單元41、一可受該驅動單元往X 軸方向驅動位移之第一平移元件31、一可隨該第一平移元件位移或產生相對位移之第二平移元件32，以及一可隨該第二平移元件位移及提供旋轉作用之旋轉單元5；數組第二平移旋轉單元3'，分別包括有一安裝於固定平台上之驅動單元41、一可受該驅動單元往Y 軸方向驅動位移之第一平移元件31、一可隨該第一平移元件位移或產生相對位移之第二平移元件32，以及一可隨該第二平移元件位移及提供旋轉作用之旋轉單元5；一量測平台2，以預定方式固定於該等第一平移旋轉單元5 與第二平移旋轉單元之旋轉單元5 上，當預定之驅動單元41作動時，便可透過該等第一平移旋轉單元3、第二平移旋轉單元3'或第一平移旋轉單元3 與第二平移旋轉單元3'個別或共同驅動該量測平台往X 軸或Y 軸位移或往預定方向旋轉。

第2 項：如申請專利範圍第1 項所述之四驅動對位對準平台，其中該旋轉單元更進一步包括有：底盤，其內部周圍形成有一容置空間，該容置空間周壁形成有預定形狀之環槽；轉動元件，可設置於底盤之容置空間中，且相對環槽的一端環設有一凹槽部，同時，

該轉動元件可用以固定支撐量測平台相對部位；固定元件，係固定於底盤頂端，且其周圍亦形成有限位槽，該限位槽亦與該凹槽部、環槽共同形成一滾動槽空間；複數滾動體，可分別容納分佈於該底盤之環槽、轉動元件之凹槽部與固定元件之限位槽所共同界定的滾動槽空間中。

- 第3項：如申請專利範圍第1項所述之四驅動對位對準平台，其中該驅動單元為一馬達。
- 第4項：如申請專利範圍第1項所述之四驅動對位對準平台，其中該驅動單元可驅動一螺桿，再藉由螺桿上之螺帽連動相對的第一平移元件產生位移。
- 第5項：如申請專利範圍第1項所述之四驅動對位對準平台，其中該驅動單元為線性馬達時，該線性馬達亦直接驅動第一平移元件產生位移。
- 第6項：如申請專利範圍第1項所述之四驅動對位對準平台，其中該第一平移旋轉單元與第二平移旋轉單元之安裝方向相差九十度。
- 第7項：如申請專利範圍第1項所述之四驅動對位對準平台，包括有二組呈對角設置之第一平移旋轉單元，以及二組呈對角設置之第二平移旋轉單元。
- 第8項：一種四驅動對位對準平台用旋轉單元5，包括：一底盤51，其內部周圍形成有一環槽512，該環槽內界定有一容置空間511，而該底盤亦再設有定位部513；一轉動元件52，可設置於底盤之容置空間中，且相對環槽的一端環設有一凹槽部521；一固定元件54，其底端係固定於底盤頂端，且其周圍亦形成有限位槽541，該限位槽512與凹槽部521（誤繕為「導接部543」）、環槽512共同形成一滾動槽空間；複數滾動體53，可分別容納分佈於滾動槽空間。
- 第9項：如申請專利範圍第8項所述之四驅動對位對準平台用旋轉單元，其中該固定元件其上係可開設通孔。
- 第10項：如申請專利範圍第8項所述之四驅動對位對準平台用旋轉單元，其中該固定元件其底部設置有複數導接部。
- 第11項：如申請專利範圍第8或10項所述之四驅動對位對準平台用旋轉單元，其中該導接部能以緊配合方式與底盤之定位部固定。
- 第12項：如申請專利範圍第8或10項所述之四驅動對位對準

平台用旋轉單元，其中該固定元件之導接部定位設置於底盤之定位部後，再以粘著劑將固定元件與底盤固定。

(四)舉發證據技術分析；

1. 證據1 為日商THK 公司型錄正本，其為整本非活頁式之型錄，正本底頁明確印有「00000000 Printed in Japan 」字樣，且經公開發行始能由參加人取得，又證據1 之印製者與證據2 專利公報之申請人均為日商THK 公司，且該證據1 內頁第1 頁亦載有「特許出願中（專利申請中）」字樣，經比對證據1 與證據2 技術內容亦相符合，足認證據1 為於系爭專利申請日即96年1 月18日之前已公開之刊物，故證據1 具有證據能力。
2. 證據1 係揭示一種對準平台，該對準平台採用了劃時代的模組構造之超薄型平台，其內頁第1 頁揭露在基座、頂盤間之四個角落將組合了十字LM導件CSR 形及特殊十字滾動圓環之模組，採用平面配置之獨特的構造，以實現超薄型構造。用途上，該對準平台適用於液晶面板製造裝置、檢查裝置、半導體製造裝置、檢查裝置、篩板印刷機、印刷基板製造裝置、檢查裝置等。又由其內頁第3 頁揭示對準平台係藉由X1、X2、Y 三軸之作動的組合，而可進行各種之平台的運動及回轉，其內頁第10頁揭示對準平台模組數可為8 組至10組，其內頁第12頁揭示超高剛性高精密度4 軸驅動規格，其內頁第13頁揭示「使LM導件、滾珠螺桿、十字滾動圓環之型號增大，且藉由將每一模組一組之定格負荷提高，而可承受高負載負荷。針對想要之搭載質量，進行最佳之模組設計、製作。」之技術特徵，證據1 內頁第1 頁上端CMX 型之基本構造圖及作動原理圖分別如附圖二所示。
3. 證據2 為西元2004年4 月2 日公開之日本特開0000000000號專利案，其公告日係早於系爭專利申請日（96年1 月18日），可為系爭專利相關之先前技術。證據2 係一種移動平台裝置，其申請專利範圍第1 項揭示：在固定基板上將下部X 軸導軌橫設在左右方向，並將下部Y 軸導軌橫設在前後方向，將X 軸套之基部可任意左右滑動的嵌入該下部X 軸導軌，將與下部X 軸導軌垂直之上部Y 軸導軌可任意前後滑動的嵌入該X 軸套之上部，將Y 軸套之基部可任意前後滑動的嵌入該下部Y 軸導軌，將與下部Y 軸導軌垂直之上部X 軸導軌可任意左右滑動的嵌入該Y 軸套之上部，並使該X 軸套向下部X 軸導軌滑動移動一所要的距離，以在固定基板上固設X 軸用移動機構，及使該Y 軸套向下部Y 軸導軌滑動移動一所要的

距離，以在固定基板上固設Y 軸用移動機構，在該上部Y 軸導軌及上部X 軸導軌上分別設置轉動支柱，於該轉動支柱之上部由軸承嵌入扣止，而於平行狀態下在固定基板之上方設置移動平台，藉由該X 軸用移動機構、Y 軸用移動機構而使移動平台相對固定基板可任意左右方向、前後方向移動、水平轉動為特徵之移動平台裝置，其代表圖式如附圖三所示。

4. 證據3 為西元2004年3 月18日公開之日本特開0000000000號專利案，其公告日早於系爭專利申請日（96年1 月18日），可為系爭專利相關之先前技術。證據3 係一種旋轉軸軸承，其說明書【0028】段揭示「如第1 圖至第3 圖所示，十字型滾輪軸承1 係概略包含內輪2 、與內輪2 大約組裝為同軸狀之外輪3 、複數個設在該內輪2 與外輪3 之間可作為轉動體任意轉動之滾輪4 及使該些滾輪4 以一定間隔保持固定之間隔扣件5 」；說明書【0029】段揭示：「內輪2 之外周面2a 上，在軸向大約中央部形成一剖面約V 字狀的溝槽。該溝槽2b係由一對相互對峙的圓錐面2c所構成」；說明書【0031】段揭示：「環部件6 之內周面6a上，其係形成一相對中心軸線L 傾斜45°之圓錐面6c，且藉由相互結合一對的環部件6，而由該二個圓錐面6c形成一剖面約V 字狀之槽6b」；說明書【0046】段揭示：「如上構成之十字型滾輪軸承1，其外輪3 係由螺絲52及固定具53結合固定在固定台51側；另一方面，內輪2 係由螺絲55及固定具56結合固定在可動平台54，且藉由容置在由內輪2 及外輪3 所形成之轉走面7，以及滾輪4 之轉動，而使可動平台54相對固定台51形成可任意旋轉，且可同時的承受來自軸向荷重、徑向荷重、力矩荷重等全方位的荷重，並可提昇相對該些荷重之耐負荷性能，因此可形成輕量且剛性較高之支撐構造」；說明書【0057】段揭示：「再者，於本實施形態中，雖然已就作為轉動體之滾輪予以說明，然而並不限定於此，例如亦可使用滾珠」之技術特徵，其代表圖式如附圖四所示。

(五)承上，系爭專利為四驅動對位對準平台，證據1 為一種對準平台、證據2 為一種移動平台裝置、證據3 為一種旋轉軸軸承，足認系爭專利與證據1、2、3 均屬量測平台移動及旋轉之結構改良，為相關之技術領域，所屬技術領域具通常知識者得以組合渠等技術內容應堪認定。原告雖於本件訴願階段主張系爭專利之使用日期早於證據1、2 及3 之前，認前揭證據不足以證明系爭專利不具進步性云云，並提出其於95年5 月11日與國立虎尾科技大學簽訂之財務採購契約書為證，但查上開採購契約之簽訂日期為95年5 月11日，晚於證據

1、2及3之公開日，不足以否定證據1、2及3之公開日早於系爭專利申請日（96年1月18日）之事實，故證據1、2及3自得做為主張系爭專利是否有違專利法第94條第4項之適格證據，併此敘明。

(六)證據1、證據2或證據1至證據3任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

1.證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

(1)系爭專利申請專利範圍第1項係一種四驅動對位對準平台，包括：數組第一平移旋轉單元3，分別包括有一安裝於固定平台上之驅動單元41、一可受該驅動單元往X軸方向驅動位移之第一平移元件31、一可隨該第一平移元件位移或產生相對位移之第二平移元件32，以及一可隨該第二平移元件位移及提供旋轉作用之旋轉單元5；數組第二平移旋轉單元3'，分別包括有一安裝於固定平台上之驅動單元41、一可受該驅動單元往Y軸方向驅動位移之第一平移元件31、一可隨該第一平移元件位移或產生相對位移之第二平移元件32，以及一可隨該第二平移元件位移及提供旋轉作用之旋轉單元5；一量測平台2，以預定方式固定於該等第一平移旋轉單元5與第二平移旋轉單元之旋轉單元5上，當預定之驅動單元41作動時，便可透過該等第一平移旋轉單元3、第二平移旋轉單元3'或第一平移旋轉單元3與第二平移旋轉單元3'個別或共同驅動該量測平台往X軸或Y軸位移或往預定方向旋轉。

(2)證據1係日商THK公司型錄，揭示一種對準平台採用了劃時代的模組構造之超薄型平台。該型錄第1頁揭示在基座、頂盤間之四個角落，將組合了十字LM導件CSR形及特殊十字滾動圓環之平移旋轉模組，採用平面配置之獨特的構造，以實現超薄型構造；該對準平台適用於液晶面板製造裝置、檢查裝置、半導體製造裝置、檢查裝置、篩板印刷機、印刷基板製造裝置、檢查裝置等；該型錄第3頁揭示對準平台係藉由X1、X2、Y三軸之作動的組合，而可進行各種之平台的運動及回轉；型錄第10頁揭示對準平台模組數可為8組至10組；型錄第12頁揭示「超高剛性高精密度4軸驅動規格」及實物照片；型錄第13頁揭示：「使LM導件、滾珠螺桿、十字滾動圓環之型號增大，且藉由將每一模組一組之定格負荷提高，而可承受高負載負荷。針對想要之搭載質量，進行最佳之模組設計、製作。」。

(3)經比對系爭專利申請專利範圍第1項與證據1，可見系爭專利申請專利範圍第1項之「一種四驅動對位對準平台、

數組第一平移旋轉單元3、驅動單元41、第一平移元件31、第二平移元件32、旋轉單元5、數組第二平移旋轉單元3'、驅動單元41、第一平移元件31、第二平移元件32、旋轉單元5、一量測平台2」已揭露於證據1之「對準平台、於基座及頂盤間之四個角落之平移旋轉模組、固定基座上的馬達、十字滾珠螺桿、十字LM導件、十字滾動圓環、頂盤固定於兩組模組上之十字滾動圓環上的組合模式」，其中系爭專利之第一平移旋轉單元3及第二平移旋轉單元3'結構相同，僅是安裝於固定平台朝向X軸或Y軸不同，而證據1型錄內頁第1頁及第3頁即揭露在基座四角朝向X1軸、X2軸及Y軸之平移旋轉模組，與系爭專利之平移旋轉單元結構相同，且由證據1型錄內頁第3頁亦揭示其可達成X方向移動、Y方向移動及中心旋轉、旋轉移動等動作亦可達成系爭專利可透過該等第一平移旋轉單元3、第二平移旋轉單元3'或第一平移旋轉單元與第二平移旋轉單元個別或共同驅動該量測平台2往X軸或Y軸位移或往預定方向旋轉之功效。因此，系爭專利四驅動對位對準平台，包括數組第一平移旋轉單元3、數組第二平移旋轉單元3'及一量測平台2，達成驅動該量測平台2往X軸或Y軸位移或往預定方向旋轉的技術及功效，顯然為證據1對準平台之頂盤可以預定之伺服馬達，透過分置四個角落的平移旋轉模組及其上之十字滾動圓環，以驅動頂盤往X方向或Y方向位移或往預定方向回旋之結構及功效所揭示，系爭專利未能產生無法預期之功效。是以，系爭專利申請專利範圍第1項應為製造對準平台所屬技術領域中具有通常知識者依證據1之先前技術或知識顯能輕易完成，不具進步性。

(4)本件原告雖主張：證據1僅顯示「CMX」型對位平台，並無法有效了解其詳細結構而無法與系爭專利進行比對，且由證據1第3頁可見其僅具三組平移單元模組與一自由單元所組成的載具平台，即為系爭專利說明書所載先前技術，而系爭專利申請專利範圍第1項旨在解決系爭專利所載先前技術台，其旋轉運動之中心會因三組驅動系統造成不固定之現象，系爭專利相較證據1確實具進步性，又證據1型錄內頁第12頁雖僅單純文字敘述「超高剛性高精密度4軸驅動規格」，而並無任何結構的揭示，其四軸如何佈設及相對關係為何均無揭露，且證據1型錄中未見任何相同或類似系爭專利有關第一、二平移旋轉單元之第一平移元件與第二平移元件的構成，證據1另外使用所謂的十字

LM導件來支持與滑動，其整體結構遠較系爭專利複雜，整體成本遠高於系爭專利，且需要另外進行導螺桿與LM導件的平行度校準，系爭專利並無此一問題，系爭專利之精確度遠高於證據1，系爭專利申請專利範圍第1項相較證據1型錄所示，確實具有進步性，並非所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成云云。惟查，由證據1型錄之封面、內頁第1頁之結構剖面圖及說明與第12頁之實物照片，可見到證據1對位平台之細部構造，而可堪與系爭專利之結構進行比對；雖然證據1型錄內頁第3頁僅揭示其具有三組平移單元，但在型錄內頁第10頁已揭示對準平台之模組數可為8組至10組，且型錄內頁第12頁揭示「超高剛性高精密度4軸驅動規格」及實物照片，可清楚看出其四組平移單元模組之佈設及相對關係。另查，由證據1型錄內頁第1頁之結構圖，可見其平移單位模組具有固定基座上的馬達、十字滾珠螺桿、十字LM導件及十字滾動圓環，其中十字LM導件位於十字滾珠螺桿上方，而十字滾動圓環位於十字LM導件上方，十字LM導件可隨十字滾珠螺桿位移或產生相對位移，雖然證據1之十字LM導件所揭之細部結構與系爭專利僅以第二平移結構之構件尚有不同，但十字LM導件與十字滾珠螺桿之連接關係及所達成之功效與系爭專利之第二平移結構與第一平移結構之連接關係及所達成之功效相同。是以，即使證據1之十字LM導件之零件及成本高於系爭專利及需要校準，但證據1型錄所揭之平移單元組件所包括之十字滾珠螺桿、十字LM導件確實已揭露系爭專利之第一、二平移旋轉單元之第一、二平移元件結構，且證據1亦可達成系爭專利高精密度之移動，故系爭專利申請專利範圍第1項應為製造對準平台所屬技術領域中具有通常知識者依證據1之先前技術或知識顯能輕易完成，不具進步性。是以，原告此部分之主張，為無理由。

2. 證據2 足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

- (1) 證據2 為一種移動平台裝置，其申請專利範圍第1項揭示：在固定基板上將下部X軸導軌橫設在左右方向，並將下部Y軸導軌橫設在前後方向，將X軸套之基部可任意左右滑動的嵌入該下部X軸導軌，將與下部X軸導軌垂直之上部Y軸導軌可任意前後滑動的嵌入該X軸套之上部，將Y軸套之基部可任意前後滑動的嵌入該下部Y軸導軌，將與下部Y軸導軌垂直之上部X軸導軌可任意左右滑動的嵌入該Y軸套之上部，並使該X軸套向下部X軸導軌滑動移動一所要的距離，以在固定基板上固設X軸用移動機構，及

使該Y 軸套向下部Y 軸導軌滑動移動一所要的距離，以在固定基板上固設Y 軸用移動機構，在該上部Y 軸導軌及上部X 軸導軌上分別設置轉動支柱，於該轉動支柱之上部由軸承嵌入扣止，而於平行狀態下在固定基板之上方設置移動平台，藉由該X 軸用移動機構、Y 軸用移動機構而使移動平台相對固定基板可任意左右方向、前後方向移動、水平轉動為特徵之移動平台裝置。

(2)經比對系爭專利申請專利範圍第1 項與證據2 ，可見系爭專利申請專利範圍第1 項之「一種四驅動對位對準平台、數組第一平移旋轉單元3 、驅動單元41、第一平移元件31 、第二平移元件32、旋轉單元5 、數組第二平移旋轉單元3'、驅動單元41、第一平移元件31、第二平移元件32 、旋轉單元5 、一量測平台2 」已揭露於證據2 之「移動平台裝置（參證據2 圖3 ）、固定基板1 上Y 方向的Y 軸用移動機構Y3（參證據2 圖3 、5 ）、安裝於固定基板1 上的步進馬達12、導軌、螺桿14、軸套Y2、移動平台4 的轉動支柱3 、固定基板1 上的X 軸用移動機構X3' 、安裝於固定基板1 上的步進馬達12、導軌、螺桿14、軸套X2等移動機構X3' 、移動平台4 的轉動支柱3 、移動平台4 」，且證據2 之移動平台4 可藉由該X 軸用移動機構、Y 軸用移動機構而使移動平台4 相對固定基板1 任意左右方向、前後方向移動、水平轉動亦可達成系爭專利可透過該等第一平移旋轉單元3 、第二平移旋轉單元3'或第一平移旋轉單元與第二平移旋轉單元個別或共同驅動該量測平台2 往X 軸或Y 軸位移或往預定方向旋轉之功效。因此，系爭專利四驅動對位對準平台，包括數組第一平移旋轉單元3、數組第二平移旋轉單元3'及一量測平台2 ，達成驅動該量測平台2 往X 軸或Y 軸位移或往預定方向旋轉的結構及功效，已為證據2 之移動平台4 藉由該X 軸用移動機構、Y 軸用移動機構而使移動平台4 相對固定基板1 任意左右方向、前後方向移動及水平轉動之結構及功效所揭示，雖然系爭專利在細部構造及配置位置上稍有差異，惟證據2與系爭專利同樣具有四組驅動移動機構及轉動機構，技術手段及功效相同，系爭專利未能產生無法預期之功效，是以，系爭專利申請專利範圍第1 項應為製造對準平台所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 之先前技術或知識顯能輕易完成，不具進步性。

(3)原告固主張：由於證據2 係另外使用十字導件14來支撐與滑動，其整體結構遠較系爭專利複雜，整體成本遠高於系

爭專利，且需要另外進行導螺桿與十字導件的平行度校準，系爭專利並無此一問題，系爭專利之精確度遠高於證據2，且證據2未見任何相同或類似系爭專利有關第一、二平移旋轉單元之第一平移元件與第二平移元件的構成，系爭專利以及簡單之結構達成精度之要求，系爭專利申請專利範圍第1項相較證據2確具進步性，並非所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成云云。惟查，由證據2可見其具有固定基座上的馬達12藉由導螺桿14驅動螺套10，螺套另設一連接體9並與十字導件連接，再於十字導件上利用轉動支柱3與移動平台產生轉動，因而十字導件可隨導螺桿位移或產生相對位移，雖然證據2之十字導件所揭之細部結構與系爭專利僅以第二平移結構之構件尚有不同，但十字導件與導螺桿之連接關係及所達成之功效與系爭專利之第二平移結構與第一平移結構之連接關係及所達成之功效相同。是以，即使證據2之十字導件之零件及成本高於系爭專利及需要校準，但證據2所揭之平移單元組件所包括之導螺桿、十字導件確實已揭露系爭專利之第一、二平移旋轉單元之第一、二平移元件結構，且證據2亦可達成系爭專利高精密度之移動，系爭專利申請專利範圍第1項應為製造對準平台所屬技術領域中具有通常知識者依證據2之先前技術或知識顯能輕易完成，不具進步性。是以原告此部分之主張，為不足採。

3. 證據1 至證據3 任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

證據3 揭示一種旋轉軸軸承，包含內輪2、與內輪2 大約組裝為同軸狀之外輪3、複數個設在該內輪2 與外輪3 之間可作為轉動體任意轉動之滾輪4 及使該些滾輪4 以一定間隔保持固定之間隔扣件5，內輪2 係由螺絲55及固定具56結合固定在可動平台54，且藉由容置在由內輪2 及外輪3 所形成之轉走面7，以及滾輪4 之轉動，而使可動平台54相對固定台51形成可任意旋轉，且可同時的承受來自軸向荷重、徑向荷重、力矩荷重等全方位的荷重，並可提昇相對該些荷重之耐負荷性能，因此可形成輕量且剛性較高之支撐構造。證據1 或證據2 之先前技術即可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，已如前述，故任意組合證據1 至3 自亦可證明系爭專利申請專利範圍第1項為製造對準平台技術領域具有通常知識者顯能輕易完成，故證據1 至證據3 任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

(七)證據1 至證據3 任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第

2 至7項不具進步性：

1. 證據1 至證據3 任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性：

(1) 查證據3 係一種旋轉軸軸承，其專利說明書【0028】段揭示「如第1 圖至第3 圖所示，十字型滾輪軸承1 係概略包含內輪2 、與內輪2 大約組裝為同軸狀之外輪3 、複數個設在該內輪2 與外輪3 之間可作為轉動體任意轉動之滾輪4 及使該些滾輪4 以一定間隔保持固定之間隔扣件5 」；專利說明書【0029】段揭示：「內輪2 之外周面2a上，在軸向大約中央部形成一剖面約V 字狀的溝槽。該溝槽2b係由一對相互對峙的圓錐面2c所構成」；專利說明書【0031】段揭示：「環部件6 之內周面6a上，其係形成一相對中心軸線L 傾斜45°之圓錐面6c，且藉由相互結合一對的環部件6，而由該二個圓錐面6c形成一剖面約V 字狀之槽6b」；專利說明書【0046】段揭示：「如上構成之十字型滾輪軸承1，其外輪3 係由螺絲52及固定具53結合固定在固定台51側；另一方面，內輪2 係由螺絲55及固定具56結合固定在可動平台54，且藉由容置在由內輪2 及外輪3 所形成之轉走面7，以及滾輪4 之轉動，而使可動平台54相對固定台51形成可任意旋轉，且可同時的承受來自軸向荷重、徑向荷重、力矩荷重等全方位的荷重，並可提昇相對該些荷重之耐負荷性能，因此可形成輕量且剛性較高之支撐構造」；專利說明書【0057】段揭示：「再者，於本實施形態中，雖然已就作為轉動體之滾輪予以說明，然而並不限定於此，例如亦可使用滾珠」。

(2) 經查，系爭專利申請專利範圍第2 項依附於申請專利範圍第1 項，係申請專利範圍第1 項之技術特徵再進一步界定旋轉單元之結構。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之申請專利範圍第1 項所有技術特徵，因任意組合證據1 至3 之先前技術可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第2 項之技術特徵在於旋轉單元更進一步包括有：底盤，其內部周圍形成有一容置空間，該容置空間周壁形成有預定形狀之環槽；轉動元件，可設置於底盤之容置空間中，且相對環槽的一端環設有一凹槽部，同時，該轉動元件可用以固定支撐量測平台相對部位；固定元件，係固定於底盤頂端，且其周圍亦形成有限位槽，該限位槽亦與該凹槽部、環槽共同形成一滾動槽空間；複數滾動體，可分別容納分佈於該底盤之環槽、轉動元件之凹槽部與固定元件之限位槽所共同

界定的滾動槽空間中，經比對系爭專利申請專利範圍第2項與證據3之結構，可見系爭專利「旋轉單元、底盤、容置空間周壁形成有預定形狀之環槽、轉動元件相對環槽的一端環設有一凹槽部、固定元件周圍形成有限位槽、限位槽與該凹槽部及環槽共同形成一滾動槽空間、複數滾動體」之結構及連接關係已揭露於證據3「滾輪軸承1、外輪3之下環部件6，及其內部圓錐面6c形成的溝6b、內輪2，及其內部圓錐面2c形成的溝6b、外輪3之上環部件6，及其內部圓錐面6c形成的溝6b、溝槽2b及6b形成之空間、複數滾輪4」之結構及連接關係，故系爭專利申請專利範圍第2項並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，任意組合證據1至3之先前技術可證明系爭專利申請專利範圍第2項之整體技術特徵不具進步性。

2. 證據1至證據3任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第3項依附於申請專利範圍第1項，係申請專利範圍第1項之技術特徵再進一步界定驅動單元為一馬達。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之申請專利範圍第1項所有技術特徵，因任意組合證據1至3之先前技術可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第3項之技術特徵在於驅動單元為一馬達，可見於證據1內頁第1頁之馬達及證據2第1圖之馬達12之結構，且並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，任意組合證據1至3之先前技術亦可證明系爭專利申請專利範圍第3項之整體技術特徵不具進步性。

3. 證據1至證據3任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第4項依附於申請專利範圍第1項，係申請專利範圍第1項之技術特徵再進一步界定其中該驅動單元可驅動一螺桿42，再藉由螺桿上之螺帽連動相對的第一平移元件產生位移。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之申請專利範圍第1項所有技術特徵，因任意組合證據1至3之先前技術可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第4項之技術特徵在於驅動單元可驅動一螺桿42，再藉由螺桿上之螺帽連動相對的第一平移元件產生位移，可見於證據1內頁第1頁之螺桿帶動螺帽及證據2圖1之螺桿14帶動螺帽10帶動連動體9產生位移之結構，且並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，任意組合證據1至3之先前技術亦可證明系爭專利申請

專利範圍第4 項之整體技術特徵不具進步性。

4. 證據1 至證據3 任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第5 項依附於申請專利範圍第1 項，係申請專利範圍第1 項之技術特徵再進一步界定驅動單元為線性馬達時，該線性馬達亦直接驅動第一平移元件產生位移。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之申請專利範圍第1 項所有技術特徵，因任意組合證據1至3 之先前技術可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第5 項之技術特徵在於驅動單元為線性馬達時，該線性馬達亦直接驅動第一平移元件產生位移，可見於證據2 專利說明書第29段採用步進馬達作為移動機構之啓動器驅動軸套產生位移之結構，且並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，任意組合證據1 至3 之先前技術亦可證明系爭專利申請專利範圍第5 項之整體技術特徵不具進步性。

5. 證據1 至證據3 任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第6 項依附於申請專利範圍第1 項，係申請專利範圍第1 項之技術特徵再進一步界定第一平移旋轉單元與第二平移旋轉單元之安裝方向相差九十度。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之申請專利範圍第6 項所有技術特徵，因任意組合證據1 至3 之先前技術可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第6 項之技術特徵在於第一平移旋轉單元與第二平移旋轉單元之安裝方向相差九十度，可見於證據1之平移旋轉模組之M1、M3及證據2 圖1 之移動機構Y3、X3亦呈90度垂直方向配置之結構，且並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，任意組合證據1 至3 之先前技術亦可證明系爭專利申請專利範圍第6 項之整體技術特徵不具進步性。

6. 證據1 至證據3 任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第7 項依附於申請專利範圍第1 項，係申請專利範圍第1 項之技術特徵再進一步界定包括有二組呈對角設置之第一平移旋轉單元，以及二組呈對角設置之第二平移旋轉單元。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之申請專利範圍第1 項所有技術特徵，因任意組合證據1 至3 之先前技術可證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第7 項之技術特徵在於

包括有二組呈對角設置之第一平移旋轉單元，以及二組呈對角設置之第二平移旋轉單元，可見於證據1 型錄內頁第12頁所示「超高剛性高精度軸驅動仕樣」構造圖及證據2 圖1 及3 所示之二組呈對角設置的移動機構Y3、X3之結構，且並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，任意組合證據1 至3 之先前技術亦可證明系爭專利申請專利範圍第7 項之整體技術特徵不具進步性。

(八)證據1 至證據3 任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第8至12項不具進步性：

1.證據1 至證據3 任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性：

(1)系爭專利申請專利範圍第8 項（獨立項）係一種四驅動對位對準平台用旋轉單元，包括：一底盤，其內部周圍形成有一環槽，該環槽內界定有一容置空間，而該底盤亦再設有定位部；一轉動元件，可設置於底盤之容置空間中，且相對環槽的一端環設有一凹槽部；一固定元件，其底端係固定於底盤頂端，且其周圍亦形成有限位槽，該限位槽與「凹槽部」（系爭專利申請專利範圍誤載為「導接部」）、環槽共同形成一滾動槽空間；複數滾動體，可分別容納分佈於滾動槽空間。

(2)經查，比對系爭專利申請專利範圍第8 項與證據3 之結構，可見系爭專利「旋轉單元、底盤、容置空間周壁形成有預定形狀之環槽、轉動元件相對環槽的一端環設有一凹槽部、固定元件周圍形成有限位槽、限位槽與該凹槽部及環槽共同形成一滾動槽空間、複數滾動體」之結構及連接關係已揭露於證據3 「滾輪軸承1 、外輪3 之下環部件6 ，及其內部圓錐面6c形成的溝6b、內輪2 ，及其內部圓錐面2c形成的溝6b、外輪3 之上環部件6 ，及其內部圓錐面6c形成的溝6b、溝槽2b及6b形成之空間、複數滾輪4 」之結構及連接關係，系爭專利申請專利範圍第8 項並未產生任何新功效或增進某種功效，應為製造對準平台所屬技術領域中具有通常知識者依證據3 之先前技術或知識顯能輕易完成，不具進步性。

(3)證據3 之先前技術即可證明系爭專利申請專利範圍第8 項不具進步性，已如前述，故任意組合證據1 至3 自亦可證明系爭專利申請專利範圍第8 項為製造對準平台技術領域具有通常知識者顯能輕易完成，故證據1 至證據3 任意組合亦足以證明系爭專利申請專利範圍第8 項不具進步性。

(4)本件原告雖主張系爭專利底盤51具有一承載轉動元件52的

容置空間511 上，使轉動單元52可獲得有效的支撐，同時固定元件54並利用導接部543 與底盤51之定位部513 相對準確定位，至於證據3 的外輪3 下部6 則呈中空狀，所以內輪唯一支撐來自於滾輪4 ，內輪2 會因支撐不足而與外輪3 產生上下錯位，同時外輪3 的上、下部件6 間單純利用螺絲來鎖設，無法準確對位，故證據3 並無法揭露系爭專利旋轉單元5 之特徵結構，系爭專利申請專利範圍第8 項之旋轉單元絕非熟悉該項技術領域者依據證據3 所能易於思及達成者云云。惟查，系爭專利申請專利範圍第8 項係揭示「…一底盤，其內部周圍形成有一環槽，該環槽內界定有一容置空間，而該底盤亦再設有定位部；一轉動元件，可設置於底盤之容置空間中，且相對環槽的一端環設有一凹槽部…」之技術特徵，僅限定「轉動元件可設置於底盤之容置空間中」，並非原告所主張「底盤51具有一承載轉動元件52的容置空間511 上，使轉動單元52可獲得有效的支撐」，且證據3 之內輪2 係設置於外輪3 之容置空間內則已揭露系爭專利上述之技術特徵。又查，系爭專利申請專利範圍第8 項另揭示「…而該底盤亦再設有定位部；…一固定元件，其底端係固定於底盤頂端…」，僅限定固定元件底端固定於底盤頂端，並非如原告所主張「固定元件54並利用導接部543 與底盤51之定位部513 相對準確定位」之技術特徵，且證據3 之外輪3 的上、下部件6利用螺絲固定則已揭露系爭專利上述之技術特徵，因而證據3 足可證明系爭專利申請專利範圍第8 項不具進步性，原告此部分之主張，尚非可採。

2. 證據1 至證據3 任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第9 項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第9 項依附於申請專利範圍第8 項，係申請專利範圍第8 項之技術特徵再進一步界定固定元件其上係可開設通孔。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之申請專利範圍第8 項所有技術特徵，因任意組合證據1 至3 結合證據之先前技術可證明系爭專利申請專利範圍第8 項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第9 項之固定元件上可開設通孔之技術特徵，可見於證據1 型錄內頁第1 頁十字滾動圓環上的螺孔及證據3 圖1 及2 外環部件6 上之螺孔之結構，且並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，任意組合證據1 至3 之先前技術亦可證明系爭專利申請專利範圍第9 項之整體技術特徵不具進步性。

3. 證據1 至證據3 任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第

10項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第10項依附於申請專利範圍第8項，係申請專利範圍第8項之技術特徵再進一步界定固定元件其底部設置有複數導接部。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之申請專利範圍第8項所有技術特徵，因任意組合證據1至3之先前技術可證明系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第10項之技術特徵在於固定元件其底部設置有複數導接部，惟證據3係以固定螺栓作為固定構件，與系爭專利所採用導接部為等效構件，系爭專利之技術特徵自為製造對準平台所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能予以置換，且系爭專利未產生無法預期的功效。是以，任意組合證據1至3之先前技術亦可證明系爭專利申請專利範圍第10項之整體技術特徵不具進步性。

4. 證據1至證據3任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第11項依附於申請專利範圍第8項及第10項，係申請專利範圍第8項及第10項之技術特徵再進一步界定其中該導接部能以緊配合方式與底盤之定位部固定。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之申請專利範圍第8項及第10項所有技術特徵，因任意組合證據1至3之先前技術可證明系爭專利申請專利範圍第8項及第10項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第11項之技術特徵在於其中該導接部能以緊配合方式與底盤之定位部固定，惟證據3係以固定螺栓作為固定構件與外環3之下端環6固定，與系爭專利所採用導接部與底盤之定位部固定為等效構件，系爭專利之技術特徵自為製造對準平台所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能予以置換，且系爭專利未產生無法預期的功效。是以，任意組合證據1至3之先前技術亦可證明系爭專利申請專利範圍第11項之整體技術特徵不具進步性。

5. 證據1至證據3任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第12項依附於申請專利範圍第8項及第10項，係申請專利範圍第8項及第10項之技術特徵再進一步界定其中該固定元件之導接部定位設置於底盤之定位部後，再以粘著劑將固定元件與底盤固定。解釋其技術特徵時，應包含其所依附之申請專利範圍第8項及第10項所有技術特徵，因任意組合證據1至3之先前技術可證明系爭專利申請

專利範圍第8項及第10項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第12項之技術特徵在於其中該固定元件之導接部定位設置於底盤之定位部後，再以粘著劑將固定元件與底盤固定，然該等於鎖固連結構件間再以黏著劑加強固定之技術手段誠屬一般公知之通常知識，散見運用於一般日常生活中，是以，系爭專利於固定元件之導接部定位設置於底盤之定位部後，再以粘著劑將固定元件與底盤固定之技術特徵為製造對準平台所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易思及，且加強固定之功效顯可預期，且並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，任意組合證據1 至3 之先前技術亦可證明系爭專利申請專利範圍第12項之整體技術特徵不具進步性。

(九)綜上所述，證據1 、證據2 或證據1 至證據3 任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，證據1 至證據3 任意組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2 至12項不具進步性，故系爭專利有違上揭專利法第94條第4 項之規定。

七、從而，被告所為舉發成立，應撤銷系爭專利權之處分，洵無違誤，訴願機關遞予維持，亦無不當；原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 12 月 22 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 熊誦梅

法 官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。

如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 100 年 12 月 22 日

書記官 王月伶